



Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Wrocławski

✉ ctt@uwr.edu.pl
☎ +48 71 375 2890

INNOWACYJNOŚĆ

- precyzyjne nanoszenie warstw na sondy pomiarowe, co zwiększa efektywność procesu i zapewnia jego powtarzalność eliminując czynnik ludzki;
- regulacja stopnia pokrycia i kontrola równomierności dzięki innowacyjnemu systemowi obrotu sondy wokół własnej osi;
- minimalizacja liczby niepożądanych defektów (np. efekt ciągnięcia materiału) powstających w procesie nanoszenia warstw.

KOMERCJALIZACJA

Licencja

OCHRONA

Wynalazek jest chroniony zgłoszeniem patentowym UPRP o nr P..448634

UPRAWNIONY

Uniwersytet Wrocławski

Urządzenie do pokrywania materiałem izolatora ostrza mikroskopu z sondą próbnikową oraz sposób pokrywania ostrza

OPIS WYNALAZKU

Przyrząd do pokrywania sond mikroskopów ze skanującą sondą. Charakteryzuje się tym, że posiada układ niezależnie kontrolowanych przesuwów umożliwiający przemieszczanie sondy, igły, ostrza w całym obszarze roboczym. Przyrząd umożliwia pozycjonowanie sondy względem zbiornika z aplikowanym materiałem. Dzięki temu można skutecznie kontrolować proces aplikacji materiału na dany obiekt, co jest istotne w celu uzyskania dokładnych i powtarzalnych pokryć. Urządzenie jest wyposażone w system obrotu pokrywanego materiału względem własnej osi. Pozwala on między innymi na regulację stopnia pokrycia i zapewnia jego równomierność. Szybkość obrotu może być regulowana i dobierana w zależności od materiału i potrzeb, co zapewnia optymalne warunki pracy i kontrolę procesu aplikacji materiału.

MOŻLIWE WYKORZYSTANIE

Wynalazek znajduje zastosowanie w preparatyce ostrzy do badania powierzchni interfejsów ciecz/ciało stałe za pomocą **mikroskopów z sondą próbnikową** (SPM, ang. *Scanning Probe Microscope*), a w szczególności **skaningowego mikroskopu tunelowego** (STM, ang. *Scanning Tunneling Microscope*).

POZIOM GOTOWOŚCI

TLR 6

Demonstracja prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

